This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(3)

(11)Publication number:

2001-033720

(43) Date of publication of application: 09.02.2001

(51)Int.CI.

G02B 26/10 B41J 2/44

(21)Application number: 11-206830

(71)Applicant: ASAHI OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

21.07.1999

(72)Inventor: HAMA YOSHIHIRO

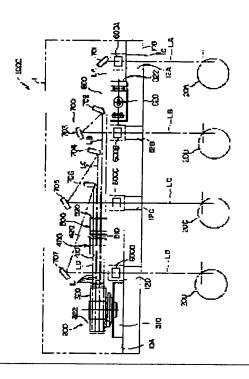
SUZUKI YASUSHI

ODANO TAMINORI MIKAJIRI SUSUMU

· (54) MULTIBEAM LIGHT SOURCE SCANNING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multibeam light source scanning device capable of securing a wide distance between objects to be irradiated, restraining optical path length from a polygon mirror to the object to be irradiated to the absolute minimum and realizing the miniaturization of an entire device. SOLUTION: An optical path bending member group 700 is constituted to guide respective light beams B emitted from a 2nd f0 lens 500 to 3rd f0 lenses 600A to 600D, and is equipped with 1st to 7th mirrors 701 to 707. The 1st mirror 701 constitutes an optical path LA to guide the light beam B positioned lowest in a vertical direction out of the light beams B emitted from a light source part 100 to a photoreceptor drum 20A arranged at the farthest position from a polygon mirror part 300.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.09.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-33720 (P2001-33720A)

(43)公開日 平成13年2月9日(2001.2.9)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
G 0 2 B 26/10		G 0 2 B 26/10	B 2C362
	102		102 2H045
B 4 1 J 2/44		B 4 1 J 3/00	D

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 16 頁)

(21)出願番号	特願平11-206830	(71)出願人	000000527
			旭光学工業株式会社
(22)出願日	平成11年7月21日(1999.7.21)		東京都板橋区前野町2丁目36番9号
		(72)発明者	浜善博
			東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光
			学工業株式会社内
		(72)発明者	鈴木 康史
			東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光
			学工業株式会社内
		(74)代理人	100089875
			弁理士 野田 茂

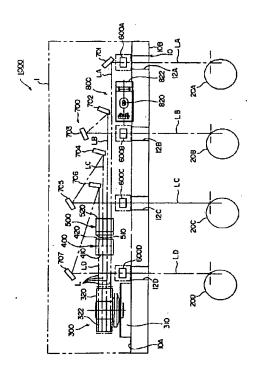
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 マルチビーム光源走査装置

'(57)【要約】

【課題】 被照射対象物間の間隔を広く確保でき、かつ、ポリゴンミラーから被照射対象物までの光路長を必要最小限の長さに抑え、装置全体を小型化することができるマルチビーム光源走査装置を提供する。

【解決手段】 光路屈曲部材群700は、第2 「 θ レンズ 5 0 0 から出射された各光ビームBを次述する各第3 f θ レンズ 6 0 0 A 乃至 6 0 0 D に導くように構成されており、第1 乃至第7ミラー701 乃至707を備えている。第1ミラー701は、光源部100から出射された光ビームBのうち、鉛直方向で最も下方に位置する光ビームBをポリゴンミラー部300から最も違い位置に配置されている感光ドラム20Aに導く光路LAを構成している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ビームを出射する複数の光源と、前記各光源から出射された前記各光ビームを偏向走査するポリゴンミラーと、前記ポリゴンミラーによって偏向走査された前記各光ビームをそれぞれ複数の被照射対象物に収束させて導く光学系とを備えるマルチビーム光源走査装置において、

1

前記光学系は光路を折り返させる複数の光路屈曲部材からなる光路屈曲部材群を有し、

前記光路屈曲部材群により、前記ポリゴンミラーから前 10 記各被照射対象物に至る複数の光路の光路長が全て同一 となるように構成され、

前記光路屈曲部材群によって構成される前記各光路のうち、前記ポリゴンミラーから最も遠い位置に配設される被照射対象物に前記光ビームを導く光路は、光ビームが 直進する2つの直線部と、光ビームの向きが変わる単一 の屈曲部を有して構成されている、

ことを特徴とするマルチビーム光源走査装置。

【請求項2】 光ビームを出射する複数の光源と、前記各光源から出射された前記各光ビームを偏向走査するポリゴンミラーと、前記ポリゴンミラーによって偏向走査された前記各光ビームをそれぞれ複数の被照射対象物に収束させて導く光学系とを備えるマルチビーム光源走査装置において、

前記光学系は光ビームを収束させる複数の f θ レンズからなる f θ レンズ群と、光路を折り返させる複数の光路 屈曲部材からなる光路屈曲部材群を有し、

前記 f θ レンズ群は、ポリゴンミラーから偏向走査された全ての光ビームが通過する第 1 f 0 レンズを有し、前記光路屈曲部材群により、前記ポリゴンミラーから前記各被照射対象物に至る複数の光路の光路長が全て同しとなるように構成され、

前記複数の被照射対象物は、前記ポリゴンミラーの一側 でポリゴンミラーから順次離れた箇所に位置するように 配置され、

前記光路屈曲部材群によって構成される前記各光路のうち、前記ポリゴンミラーから最も近い位置に配設される被照射対象物に前記光ビームを導く光路は、前記ポリゴンミラーと前記第1f θ レンズとの間の箇所を通過する光路部分を有して構成されている、

ことを特徴とするマルチビーム光源走査装置。

【請求項3】 光ビームを出射する3つ以上の光源と、前記各光源から出射された前記各光ビームを偏向走査するポリゴンミラーと、前記ポリゴンミラーによって偏向走査された前記各光ビームを前記光ビームの数に等しい数の被照射対象物に収束させて導く光学系とを備えるマルチビーム光源走査装置において、

前記光学系は光路を折り返させる複数の光路屈曲部材からなる光路屈曲部材群を有し、

前記光路屈曲部材群により、前記ポリゴンミラーから前 50 ていることを特徴とする請求項5または6記載のマルチ

記各被照射対象物に至る複数の光路の光路長が全て同一 となるように構成され、

前記ポリゴンミラーから前記各被照射対象物に至る複数の光路のうちの1つの光路はポリゴンミラーの一側を通過する光路部分を有し、残りの全ての光路はポリゴンミラーの他側を通過する光路部分を有するように構成されている

ことを特徴とするマルチビーム光源走査装置。

【請求項4】 前記光学系は光ビームを収束させる複数のf0レンズからなるf0レンズ群をさらに有し、前記f0レンズ群は、ボリゴンミラーから偏向走査された全ての光ビームが通過する第1f0レンズを有し、前記ポリゴンミラーの他側を通過する光路部分を有する残りの全ての光路は、前記ポリゴンミラーの他側でポリゴンミラーから順次離れた箇所に位置するように配置された複数の前記被照射対象物に導かれるように構成され、前記残り全ての光路のうち、前記ポリゴンミラーから最も近い位置に配設される被照射対象物に前記光ビームを導く光路は、前記ポリゴンミラーと前記第1f0レンズとの間の箇所を通過する光路部分を有して構成されていることを特徴とする請求項3記載のマルチビーム光源走査装置。

【請求項5】 前記光学系は光ビームを収束させる複数の「 θ レンズからなる「 θ レンズ群をさらに有し、前記 f θ レンズ群は単一の第1 f θ レンズと、単一の第2 f θ レンズと、前記光源の数に対応した数の第3 f θ レンズを有し、前記各光ビームは第1 f θ レンズおよび第2 f θ レンズを通過すると共に、第2 f θ レンズを通過したのち各第3 f θ レンズを通過するように構成されていることを特徴とする請求項1または3記載のマルチビーム光源走査装置。

【請求項6】 前記 $[\theta \nu \nu x$ 群は、単一の第2 $[\theta \nu \nu x$ 本と、前記光源の数に対応した数の第3 $[\theta \nu \nu x$ をらに有し、前記各光ビームは第1 $[\theta \nu \nu x$ および第2 $[\theta \nu \nu x$ を通過すると共に、第2 $[\theta \nu \nu x$ を通過したのち各第3 $[\theta \nu \nu x$ を通過するように構成されていることを特徴とする請求項2または4記載のマルチビーム光源走査装置。

【請求項7】 前記第1f0レンズは、主に前記各光ビームの前記主走査方向と直交する副走査方向の収束を行うように構成されていることを特徴とする請求項2、

4、5または6記載のマルチビーム光源走査装置。

【請求項8】 前記第2 f 0 レンズは前記各光ビームの全てが通過され、かつ、各光ビームの主走査方向の収束のみを行うように構成されていることを特徴とする請求項5または6記載のマルチビーム光源走査装置。

【請求項9】 前記第3 f θ レンズを構成する前記複数 個の f θ レンズは、主にそれぞれ光ビームの前記主走査 方向と直交する副走査方向の収束を行うように構成され ていることを特徴とする請求項5または6 記載のマルチ

ビーム光源走査装置。

前記ポリゴンミラーは、前記各光ビー 【請求項10】 ムを偏向走査する反射面を有し、前記反射面は前記各光 ビームの全てを偏向走査する単一の面から構成されてい ることを特徴とする請求項1乃至10に何れか1項記載 のマルチビーム走査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は複数の光源から出射 される光ビームを感光ドラムなどの被照射対象物に対し て走査するマルチビーム光源走査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】モノクロのレーザプリンタなどに適用さ れる光走査装置は、画素信号により発光される半導体レ ーザを備え、この半導体レーザから出力されるレーザビ ーム(以下光ビームという)はコリメートレンズにより 平行光に変換された後、ポリゴンミラーにより水平方向 に走査偏向され、この光ビームを f θ レンズで屈折、集 光させて感光ドラムの表面に入射し、感光ドラム表面を 画素信号の強度に応じて露光する。そして、この露光像 をトナーで現像した後、このトナー像を記録紙に転写し 定着処理を施すことにより、画像情報を記録紙に印画定 着するようになっている。

【0003】また、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラ ックの各色に対応したトナー像を記録紙に転写すること でカラー画像を印画するカラープリンタやカラー複写機 などの画像形成装置に適用される光走査装置として、各 色毎に独立した光源を用いたマルチビーム光源走査装置 がある。このマルチビーム光源走査装置は、イエロー、 マゼンタ、シアン、ブラックの各色毎に独立した光源と 各色毎に独立した f θ レンズを備え、各色毎に独立した 感光ドラムにそれぞれの色に対応した光ビームを照射し て露光するように構成されており、各色毎に露光、現 像、転写の各プロセスが行なわれ、最後に定着装置によ り4色同時に定着して、カラー画像が記録紙に印画定着 されるようになっている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述したマルチビーム 光源走査装置においては、各色毎に独立した感光ドラム 間の間隔を広く確保することが必要である。これは、感 光ドラムの周囲に配設される各プロセスを行う各プロセ ス部材、すなわち除電部、帯電部、現像部、転写部を小 型化することに限界があるため、これら感光ドラムの周 囲のスペースが広いほど有利であることと、現像部にト ナーを供給するトナー収容部はそれが収容するトナーの 容量が大きいほど、トナーの補給回数を低減できるとい う利点があるからである。一方、 Γ θ レンズを含む光学 系においては、ポリゴンミラーから各感光ドラムまでの 光路長を必要最小限の長さに抑えることが必要である。

が長くなるほど、光ビームを収束するための f 0 レンズ が大型となり、装置全体も大型化してしまうためであ る。本発明は前記事情に鑑み案出されたものであって、 本発明の目的は、被照射対象物間の間隔を広く確保で き、かつ、ポリゴンミラーから被照射対象物までの光路 長を必要最小限の長さに抑え、装置全体を小型化するこ とができるマルチビーム光源走査装置を提供することに ある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、光ビームを出 射する複数の光源と、前記各光源から出射された前記各 光ビームを偏向走査するポリゴンミラーと、前記ポリゴ ンミラーによって偏向走査された前記各光ビームをそれ ぞれ複数の被照射対象物に収束させて導く光学系とを備 えるマルチビーム光源走査装置において、前記光学系は 光路を折り返させる複数の光路屈曲部材からなる光路屈 曲部材群を有し、前記光路屈曲部材群により、前記ポリ ゴンミラーから前記各被照射対象物に至る複数の光路の 光路長が全て同一となるように構成され、前記光路屈曲 部材群によって構成される前記各光路のうち、前記ポリ ゴンミラーから最も遠い位置に配設される被照射対象物 に前記光ビームを導く光路は、光ビームが直進する2つ の直線部と、光ビームの向きが変わる単一の屈曲部を有 して構成されていることを特徴とする。そのため、本発 明によれば、ポリゴンミラーから最も遠い位置に配置さ れている被照射対象物までの光路の光路長を必要最小限 の長さに抑えれば、ポリゴンミラーから他の被照射対象 物までの光路長も上記光路長と同じく同じ必要最小限の 長さとなるように構成することができる。したがって、 ポリゴンミラーと各被照射対象物間の相対距離を短く構 成するとともに、各被照射対象物間の間隔を十分に確保 することが可能となる。

【0006】また、本発明は、光ビームを出射する複数 の光源と、前記各光源から出射された前記各光ビームを 偏向走査するポリゴンミラーと、前記ポリゴンミラーに よって偏向走査された前記各光ビームをそれぞれ複数の 被照射対象物に収束させて導く光学系とを備えるマルチ ビーム光源走査装置において、前記光学系は光ビームを 収束させる複数の「θレンズからなる「θレンズ群と、 光路を折り返させる複数の光路屈曲部材からなる光路屈 40 曲部材群を有し、前記光路屈曲部材群により、前記ポリ ゴンミラーから前記各被照射対象物に至る複数の光路の 光路長が全て同一となるように構成され、前記複数の被 照射対象物は、前記ポリゴンミラーの一側でポリゴンミ ラーから順次離れた箇所に位置するように配置され、前 記光路屈曲部材群によって構成される前記各光路のう ち、前記ポリゴンミラーから最も近い位置に配設される 被照射対象物に前記光ビームを導く光路は、前記ポリゴ ンミラーと前記第1 ſ θ レンズとの間の箇所を通過する これは、ポリゴンミラーから各感光ドラムまでの光路長 50 光路部分を有して構成されていることを特徴とする。そ

のため、本発明によれば、ポリゴンミラーとこのボリゴンミラーから最も近い位置に配設される被照射対象物との間の相対距離を短く構成するとともに、隣接する被照射対象物間の間隔を十分に確保することが可能となる。

【0007】また、本発明は、光ビームを出射する3つ 以上の光源と、前記各光源から出射された前記各光ビー ムを偏向走査するポリゴンミラーと、前記ポリゴンミラ 一によって偏向走査された前記各光ビームを前記光ビー ムの数に等しい数の被照射対象物に収束させて導く光学 系とを備えるマルチビーム光源走査装置において、前記 光学系は光路を折り返させる複数の光路屈曲部材からな る光路屈曲部材群を有し、前記光路屈曲部材群により、 前記ポリゴンミラーから前記各被照射対象物に至る複数 の光路の光路長が全て同一となるように構成され、前記 ポリゴンミラーから前記各被照射対象物に至る複数の光 路のうちの1つの光路はポリゴンミラーの一側を通過す る光路部分を有し、残りの全ての光路はポリゴンミラー の他側を通過する光路部分を有するように構成されてい ることを特徴とする。そのため、本発明によれば、ポリ ゴンミラーから各被照射対象物までの相対距離を短く構 成するとともに、各被照射対象物間の間隔を十分に確保 することが可能となり、また装置全体を小型化できる。

【0008】また、本発明は、前記複数の光源を、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色に対応して設けることができる。また、本発明は、前記複数の被照射対象物をイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色に対応して設けられた感光ドラムとし、前記各光ビームが前記走査機構によって走査される方向を各感光ドラムの長さ方向とすることができる。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。なお、本実施の形態では、 マルチビーム光源走査装置がカラー画像形成装置に適用 された場合について説明する。図1は本発明の第1の実 施の形態のマルチビーム光源走査装置の構成を示す平面 図、図2は図1をAA線断面から見た状態を示す断面図 である。マルチビーム光源走査装置1000は、筐体1 の底壁10と、この底壁10の上面10Aに配設された 各部、すなわち光源部100、シリンダレンズ部20 0、ポリゴンミラー部300、第1 f f レンズ400、 第2 f θレンズ500、第3 f θレンズ600A乃至6 00D、光路屈曲部材群700(図2にのみ示されてい る)、水平同期検知部800などから構成されている。 第1 f θレンズ400、第2 f θレンズ500、第3 f θレンズ600A乃至600D、光路屈曲部材群700 は、特許請求の範囲の光学系に相当している。

【0010】図2に示されているように、底壁10は、水平方向に延在し、その下方には底壁10の下面10Bと間隔をおいて、4個の感光ドラム20A、20B、20C、20D(特許請求の範囲の被照射対象物に相当)

が互いに水平方向に間隔をおいて軸線が平行をなした状態で回転可能に設けられている。そして、各感光ドラム20A、20B、20C、20Dは、平面から見てポリゴンミラー部300の一側において、ボリゴンミラー部300から上記順番と逆の順番で順次離れた箇所に位置するように配置されている。同様に各第3f0レンズ600A乃至600Dも平面から見てポリゴンミラー部300の一側において、ポリゴンミラー部300の一側において、ポリゴンミラー部300の一側とされている。なお、ポリゴンミラー部300の一側とは、ポリゴンミラー320によって偏向走査される光ビームLの光路が位置する側(前側)である。

【0011】また、平面から見てポリゴンミラー部300に最も近い位置に配置される感光ドラム20Dはポリゴンミラー部300と第1fのレンズ400との間の箇所に位置するように配置されている。同様に、平面から見てポリゴンミラー部300に最も近い位置に配置される第3fのレンズ600Dはポリゴンミラー部300と第1fのレンズ400との間の箇所に位置するように配置されている。各感光ドラム20A、20B、20C、20Dは、カラー画像を形成するために必要な互いに異なる色(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)に対応して設けられており、これらイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのトナーを記録紙に転写するように構成されている。

【0012】マルチビーム光源走査装置1000の概略 動作は以下の通りである。すなわち、光源部100から シリンダレンズ部200のシリンダレンズ230を通過 した4本の光ビームしは、ポリゴンミラー部300によ って主走査方向に偏向走査される。走査された各光ビー ムしは、第1 f θ レンズ4 0 0、第2 f θ レンズ5 0 0、光路屈曲部材群 7 0 0、第 3 f θ レンズ 6 0 0 を介 して各感光ドラム20A、20B、20C、20D上に 収束されて主走査方向に偏向走査されるように構成され ている。ポリゴンミラー部300によって走査された各 光ビームしは、水平同期用検知部800に導かれ、この 水平同期用検知部800の検知動作に基いて主走査方向 の書き込み開始位置のタイミング同期が取られる。な お、各光ビームLの主走査方向は、各感光ドラム20 A、20B、20C、20Dの長さ方向に沿っており、 この主走査方向と直交する走査方向が副走査方向とな

【0013】次に各部の構成について詳細に説明する。 光源部100は、出力する光ビームLの波長が同一となる4個の半導体レーザ120A乃至120Dから出射される各光ビームLを平行光にするための4個のコリメータレンズと、 各半導体レーザを駆動するための半導体レーザ駆動回路とを備えて構成されている。そして、光源部100は、 50 各半導体レーザ120A乃至120Dから各コリメータ

20

レンズを通過して出射される平行光となった各光ビーム しが、それぞれの光軸が平面からみて一致し、鉛直方向 に同一の間隔をおいて平行をなすように構成されてい る。

【0014】シリンダレンズ部200は、壁部10の上 面10Aに取着されたベース210と、このベース部2 10から立設されたレンズ保持部220と、レンズ保持 部220によって保持されたシリンダレンズ230とを 有している。シリンダレンズ230は、光源部100か ら出射された各光ビームLを入射する入射面230A と、入射した各光ビームしを出射する出射面230Bと を有している。そして、シリンダレンズ230は、光源 部100から出射された平行光となった各光ビームしを 入射してこれら各光ビーム L を水平方向 (主走査方向) は収束せず、鉛直方向(副走査方向)にのみ収束してポ リゴンミラ一部300へ出射するように構成されてい る。そして、シリンダレンズ230の焦点位置、すなわ ち各光ビームしが最も収束されて水平方向に延在する線 像となる位置は、後述するポリゴンミラー320の反射 面322の位置となるように設定されている。

【0015】ポリゴンミラー部300は、底部10の上 面10Aに取着されたモータ部310と、モータ部31 0の鉛直方向に向けられた回転軸312に取着されたポ リゴンミラー320とを有している。ポリゴンミラー3 20は、平面から見て6個の反射面322が正6角形を なすように設けられており、各反射面322は水平面に 対して直交している。そして、各反射面322はそれぞ れ単一の面を形成しており、この単一の面にシリンダレ ンズ230から出射された各光ビームしが入射するよう になっている。図1において、モータ部310は、図略 のモータ制御回路から入力される駆動信号によって等速 で反時計回転の方向に高速回転されるようになってお り、これにより、各光ビームしは、紙面下方から上方に 向かう主走査方向に偏向走査される。

【0016】第1f θレンズ400は、後述する第2、 第3 f θ レンズ500、600と共に f θ レンズ群を構 成しており、この θ レンズ群はポリゴンミラー320 によって主走査方向に走査される各光ビームしを各感光 ドラム20A乃至20D上に収束させる作用を果たす。 第1fθレンズ400は、ポリゴンミラー320によっ て偏向走査された各光ビームしを入射するように構成さ れており、底壁10の上面10Aに図略の保持部材を介 して取着されている。第1 f 0 レンズ400は、単一の 素材からなる単一の部材として構成されている。第1 f θレンズ400は、半導体レーザ120A乃至120D の各光ビームしが入射される入射面410と、入射面4 10に入射された各光ビームしがそれぞれ出射される出 射面420を有している。出射面420は、各光ビーム しに対応して4つの光軸を有した形状を呈しており、上

ように構成されている。したがって、鉛直方向に等間隔 で並んで入射面410に入射された各光ビームしは、出 射面420からそれぞれ鉛直方向に等間隔をおいた状態 で出射されるようになっている。第110レンズ400 は、各光ビームしを主として鉛直方向(副走査方向)に 収束させる作用を有し、水平方向(主走査方向)にも収 東させる作用も有している。ここで、第1 f 0 レンズ4 00による光ビーム Lを水平方向に収束させる作用は、 鉛直方向に光ビームしを収束させる作用よりも弱くなる ように構成されている。

【0017】第2f θ レンズ500は、第1f θ レンズ 400から出射された光ビームしが入射される入射面5 10と、この入射面510に入射された光ビームしが出 射される出射面520とを有し、底壁10の上面10A に図略の保持部材を介して取着されている。第2f 0 レ ンズ500は、単一の素材からなる単一の部材で構成さ れており、各光ビームしの全てがこの単一の部材を通過 するようになっている。第2 f θ レンズ500は、各光 ビームしを水平方向(主走査方向)にのみ収束させ、鉛 直方向(副走査方向)には収束させない作用を有してい る。

【0018】光路屈曲部材群700は、第210レンズ 500から出射された各光ビームLを次述する各第3f 0 レンズ600A乃至600Dに導くように構成されて おり、第1乃至第7ミラー701乃至707を備えてい る。これら第1乃至第7ミラー701乃至707は、光 ビームしを反射する反射面を有し、特許請求の範囲の光 路屈曲部材に相当するものである。

【0019】第1ミラー701は、光源部100から出 射された光ビームしのうち、鉛直方向で最も下方に位置 する光ビームしをポリゴンミラー部300から最も遠い 位置に配置されている感光ドラム20Aに導く光路LA を構成している。第2、第3ミラー702、703は、 光源部100から出射された光ビームしのうち、鉛直方 向で下方から2番目に位置する光ビームしをポリゴンミ ラ一部300から2番目に遠い位置に配置されている感 光ドラム20Bに導く光路LBを構成している。第4、 第5ミラー704、705は、光源部100から出射さ れた光ビームしのうち、鉛直方向で下方から3番目に位 置する光ビームしをポリゴンミラー部300から3番目 に遠い位置に配置されている感光ドラム20 Cに導く光 路しCを構成している。第6、第7ミラー706、70 7は、光源部100から出射された光ビームしのうち、 鉛直方向で下方から4番目(すなわち鉛直方向で最も上 方)に位置する光ビームしをポリゴンミラー部300か ら4番目に遠い位置(すなわち相対的に最も近い位置) に配置されている感光ドラム20Dに導く光路LDを構 成している。図2から明らかなように光路LA乃至LD は互いに平行をなし、互いに鉛直方向に等間隔をおいて 記各光軸が鉛直方向に等間隔をおいて互いに平行をなす 50 配置されており、さらに詳しく説明すれば、最も下方の

10

位置に光路しAが配置され、光路しAの直上に光路LB が、光路LBの直上に光路LCが、光路LCの直上に光 路LDがそれぞれ配置されている。

【0020】これら第1乃至第7ミラー701乃至70 7はそれぞれ光ビームLの主走査方向にわたって延在し て設けられており、図略の保持部材を介して底壁10の 上面10Aに取着されている。

【0021】第3f θレンズ600A乃至600Dは、 各光ビームLを主に副走査方向に収束させる作用を有 し、水平方向(主走査方向)にも収束させる作用も有し ている。ここで、第3 f θ レンズ600A乃至600D による光ビームしを収束させる作用は、鉛直方向に光ビ 一ムしを収束させる作用よりも弱くなるように構成され ている。

【0022】一方、底壁10には、各感光ドラム20A 乃至2000上部に臨む箇所に、各感光ドラム20A乃 至20Dの軸線と平行に、すなわち光ビームLの主走査 方向にわたって延在する開口12A乃至12Dが底壁1 0の厚さ方向(鉛直方向)に貫通して設けられている。 これら開口12A乃至12Dの上面10A側の周縁部に それぞれ第3fθレンズ用の保持部材610A乃至61 OD (図1にのみ示す) が設けられ、これら保持部材 6 10A乃至610Dによって第3f0レンズ600A乃 至600Dが保持されている。すなわち、fθレンズ6 00A乃至600Dは各光ビームLのそれぞれに対応し た個別の箇所で光ビームLの主走査方向にわたって延在 している。そして、第3f0レンズ600A乃至600 Dは、それぞれ光ビームLが入射される入射面と、これ ら入射面に入射された各光ビームしが出射される出射面 とを有している。

【0023】ここで、第1乃至第7ミラー701乃至7 07からなる光路屈曲部材群700によって構成される 各光路について詳細に説明する。単一の第1ミラー70 1によって構成される光路LAは、第2f0レンズ50 0の出射面520から第1ミラー701に到達するまで の光ビームしが直進する直線部と、第1ミラー701に よって光ビームLが下方に折り返される屈曲部と、第1 ミラー701によって折り返された光ビームしが第3日 θ レンズ600Aを通過して感光ドラム20Aに到達す るまでの直線部とを有して構成されている。つまり、上 40 記光路 LAは、光ビームしが直進する2つの直線部と、 光ビームの向きが変わる単一の屈曲部を有して構成され

【0024】第2、第3ミラー702、703によって 構成される光路LBは、第2f θレンズ500の出射面 520から第2ミラー702に到達するまでの光ビーム Lが直進する直線部と、第2ミラー702によって光ビ ームしが上方に折り返される屈曲部と、第2ミラー70 2によって折り返された光ビームしが第3ミラー703

光ビームしが下方に折り返される屈曲部と、第3ミラー 703によって折り返された光ビームしが第3f0レン ズ600Bを通過して感光ドラム20Bに到達するまで の直線部とを有して構成されている。つまり、上記光路 LBは、光ビームLが直進する3つの直線部と、光ビー ムの向きが変わる2つの屈曲部を有して構成されてい る。

【0025】第4、第5ミラー704、705によって 構成される光路LCは、第2fθレンズ500の出射面 520から第4ミラー704に到達するまでの光ビーム Lが直進する直線部と、第4ミラー704によって光ビ ームしが上方に折り返される屈曲部と、第4ミラー70 4によって折り返された光ビームしが第5ミラー705 に到達するまでの直線部と、第5ミラー705によって 光ビームしが下方に折り返される屈曲部と、第5ミラー 705によって折り返された光ビームLが第3f θレン ズ600Cを通過して感光ドラム20Cに到達するまで の直線部とを有して構成されている。つまり、上記光路 LCは、光ビームLが直進する3つの直線部と、光ビー ムの向きが変わる2つの屈曲部を有して構成されてい

【0026】第6、第7ミラー706、707によって 構成される光路LDは、第2f θレンズ500の出射面 520から第6ミラー706に到達するまでの光ビーム しが直進する直線部と、第6ミラー706によって光ビ ーム L が上方に折り返される屈曲部と、第6ミラー70 6によって折り返された光ビームLが第7ミラー707 に到達するまでの直線部と、第7ミラー707によって 光ビームしが下方に折り返される屈曲部と、第7ミラー 707によって折り返された光ビームLが第3f0レン ズ600Dを通過して感光ドラム20Dに到達するまで の直線部とを有して構成されている。つまり、上記光路 LDは、光ビームLが直進する3つの直線部と、光ビー ムの向きが変わる2つの屈曲部を有して構成されてい る。また、上記光路し口のうち、第6ミラー706によ って折り返された光ビームLが第7ミラー707に到達 するまでの直線部は、第1、第2f 0レンズ400、5 00の上方の箇所を通過する光路部分を有している。さ らに、上記光路LDのうち、第7ミラー707によって 折り返された光ビームLが第3 f θ レンズ600Dを通 過して感光ドラム20Dに到達するまでの直線部は、ポ リゴンミラー部300と第1 f θ レンズ600Dの間の 箇所を通過する光路部分を有している。

【0027】第1、第3f θレンズ400、600の作 用により各光ビームしを主に副走査方向に収束させ、第 2 「 0 レンズ 5 0 0 の作用により各光ビーム L を主走査 方向に収束させている。この結果、ポリゴンミラー32 0の反射面322の位置で水平方向に延在する線像とな った各光ビームしは、この反射面322によって偏向走 に到達するまでの直線部と、第3ミラー703によって 50 査された後、上記第1乃至第3「θレンズ400、50

0、600の作用によって各感光ドラム20A乃至20 Dの面の位置で主走査方向および副走査方向の両方向に 収束され点像となるようになっている。

【0028】なお、光源部100から出射された4つの 光ビームが各感光ドラム20A乃至20Dの面の位置で 主走査方向および副走査方向の両方向に収束され点像と なるようにするために、光源部100の各コリメートレ ンズから各感光ドラム20A乃至20Dに至る4つの光 路の光路長は全て同一となるように、すなわちポリゴン ミラー322から各感光ドラム20A乃至20Dに至る 4つの光路の光路長も全て同一となるように構成されて いる。

【0029】水平同期検知部800は、ミラー810 と、受光センサ820とを有して構成されている。ミラ -810は、感光ドラムのビーム主走査方向において、 画像形成に寄与する走査範囲から外れた手前の所定位置 に配設され、この所定位置に到達した光ビームしを受光 センサ820へ反射させるように底壁10の上面10A に取付部材812によって取着されている。受光センサ 820は、第2fθレンズ500を通過する光ビームL 20 のうちミラー810によって導かれた画像形成に寄与し ない走査範囲の光ビームしを入射するように底壁10の 上面10Aに取付部材822によって取着されている。 受光センサ820から出力される受光信号に基いて各半 導体レーザ120A乃至120Dの駆動信号を制御する ことで感光ドラム20A乃至20Dに対する主走査方向 への書き込み開始位置のタイミング同期が取られるよう になっている。

【0030】上述のように構成されたマルチビーム光源 走査装置 1000によれば、発光部 100 から出射され 30 シリンダレンズ 230 を通過した各光ビーム L は、ポリゴンミラー 320 の各反射面 322 にによって偏向走査され第 $1f\theta$ レンズ 400、第 $2f\theta$ レンズ 500 に入射されて収束される。そして、第 $2f\theta$ レンズ 500 から出射された各光ビーム L は前述の各光路 L A 乃至 L D によって第 $3f\theta$ レンズ 600 A 乃至 600 D に導かれ 各感光ドラム 200 A 乃至 200 上に点像として収束された状態で主走査方向に走査される。

【0031】以上詳述した第1の実施の形態においては、ポリゴンミラー部300、すなわちポリゴンミラー320から最も遠い位置に配置されている感光ドラム20Aに光ビームLを導く光路LAは、光ビームLが直進する2つの直線部と、光ビームの向きが変わる単一の配曲部を有して構成されている。したがって、ポリゴンミラー320から最も遠い位置に配置されている感光ドラム20Aまでの光路LAの光路長を必要最小限の長さで構成すれば、ポリゴンミラー320から他の感光ドラム20B、20C、20Dまでの光路も光路屈曲部材群700によって上記光路長と同じ必要最小限の光路長となるように構成することができる。

12

【0032】また、ポリゴンミラー320から最も近い 位置に配設される感光ドラム20Dに光ビームしを導く 光路しDは、ボリゴンミラー320と第1[0レンズ4 00との間の箇所を通過する光路部分を有しているた め、平面から見てポリゴンミラー320と感光ドラム2 ODの間、およびポリゴンミラー320と第3fθレン ズ60000間の相対距離をそれぞれ短くすることが可 能となる。これらのことにより、各感光ドラム20A乃 至20D間の間隔を必要な分確保した上で、ポリゴンミ ラー320から各感光ドラム20A乃至20D間までの 光路LA乃至LDの全ての光路長を同一の長さとなるよ うに構成することが可能となる。そのため、各感光ドラ ムの周囲に各プロセスを行う除電部、帯電部、現像部、 転写部を配置するスペースを十分に確保することができ る。また、これらのスペースを確保することで上記現像 部にトナーを供給するトナー収容部の配置スペースも確 保できるのでそのトナー容量を大きくすることができ る。また、ポリゴンミラーから各感光ドラムまでの相対 距離を短くできるので、このマルチビーム光源走査装置 全体を小型化することができる。

【0033】図3は本発明の第2の実施の形態のマルチ ビーム光源走査装置を縦断面から見た状態を示す断面図 である。図3において、第1の実施の形態を示す図1、 図2と同一部分には同一の符号を付してその説明を省略 する。第2の実施の形態のマルチビーム光源走査装置1 000Aが第1の実施の形態のマルチビーム光源走査装 置1000と異なるのは、光路屈曲部材群710の構成 のみであるため、以下では光源屈曲部材群710の構成 を中心に説明する。第2の実施の形態において光源屈曲 部材群710は、第1乃至第9ミラー711乃至719 から構成されている。第1ミラー711は、光源部10 0から出射された光ビームしのうち、鉛直方向で最も下 方に位置する光ビームしをポリゴンミラー部300から 最も遠い位置に配置されている感光ドラム20Aに導く 光路LAを構成している。第2、第3ミラー712、7 13は、光源部100から出射された光ビームしのう ち、鉛直方向で下方から2番目に位置する光ビームしを ポリゴンミラー部300から2番目に遠い位置に配置さ れている感光ドラム20Bに導く光路LBを構成してい る。したがって、上記第1乃至第3ミラー711乃至7 13は、第1の実施の形態における第1乃至第3ミラー 701乃至703と同様の構成となっている。

【0034】第4乃至第6ミラー714乃至716は、 光源部100から出射された光ビームしのうち、鉛直方 向で下方から3番目に位置する光ビームしをポリゴンミ ラー部300から3番目に遠い位置に配置されている感 光ドラム20Cに導く光路してを構成している。第7乃 至第9ミラー717乃至719は、光源部100から出 射された光ビームしのうち、鉛直方向で下方から4番目 (すなわち鉛直方向で最も上方)に位置する光ビームし

をポリゴンミラー部300から4番目に遠い位置(すなわち相対的に最も近い位置)に配置されている感光ドラム20Dに導く光路LDを構成している。これら第1乃至第9ミラー711乃至719はそれぞれ光ビームしの主走査方向にわたって延在して設けられており、図略の保持部材を介して底壁10の上面10Aに取着されている。

【0035】単一の第1ミラー711によって構成される光路LAは、第2f θ レンズ500の出射面520から第1ミラー711に到達するまでの光ビームLが直進する直線部と、第1ミラー701によって光ビームLが下方に折り返される屈曲部と、第1ミラー711によって折り返された光ビームLが第3f θ レンズ600Aを通過して感光ドラム20Aに到達するまでの直線部とを有して構成されている。つまり、上記光路LAは、光ビームLが直進する2つの直線部と、光ビームの向きが変わる単一の屈曲部を有して構成されている。

【0036】第2、第3ミラー712、713によって構成される光路LBは、第2f θ レンズ500の出射面520から第2ミラー712に到達するまでの光ビームLが直進する直線部と、第2ミラー712によって光ビームLが上方に折り返される屈曲部と、第2ミラー712によって折り返された光ビームLが第3ミラー713によって折り返される屈曲部と、第3ミラー713によって折り返された光ビームLが第3f θ レンズ600Bを通過して感光ドラム20Bに到達するまでの直線部とを有して構成されている。つまり、上記光路LBは、光ビームLが直進する3つの直線部と、光ビームの向きが変わる2つの屈曲部を有して構成されている。

【0037】第4乃至第6ミラー714乃至716によ って構成される光路LCは、第2f θ レンズ500の出 射面520から第4ミラー714に到達するまでの光ビ ームLが直進する直線部と、第4ミラー714によって 光ビームしが下方に折り返される屈曲部と、第4ミラー 714によって折り返された光ビームしが第5ミラー7 15に到達するまでの直線部と、第5ミラー715によ って光ビームしが上方に折り返される屈曲部と、第5ミ ラー715によって折り返された光ビームしが第6ミラ ー716に到達するまでの光ビームLが直進する直線部 と、第6ミラー716によって光ビームしが下方に折り 返される屈曲部と、第6ミラー716によって折り返さ れた光ビームしが第3 f 0 レンズ600℃を通過して感 光ドラム20Cに到達するまでの直線部とを有して構成 されている。つまり、上記光路LCは、光ビームLが直 進する4つの直線部と、光ビームの向きが変わる3つの 屈曲部を有して構成されている。

【0038】第7乃至第9ミラー716乃至719によれら保持部材によって第って構成される光路し口は、第2f0レンズ500の出 50 0Dが保持されている。

射面520から第7ミラー717に到達するまでの光ビ ームしが直進する直線部と、第7ミラー717によって 光ビームしが上方に折り返される屈曲部と、第7ミラー 717によって折り返された光ビームしが第8ミラー7 18に到達するまでの直線部と、第8ミラー718によ って光ビームレが水平方向に折り返される屈曲部と、第 8ミラー718によって折り返された光ビームしが第9 ミラー719に到達するまでの光ビームLが直進する直 線部と、第9ミラー719によって光ビームが下方に折 り返される屈曲部と、第9ミラー719によって折り返 された光ビームしが第3 [θレンズ600Dを通過して 感光ドラム20Dに到達するまでの直線部とを有して構 成されている。つまり、上記光路LDは、光ビームレが 直進する4つの直線部と、光ビームの向きが変わる3つ の屈曲部を有して構成されている。また、上記光路LD のうち、第8ミラー718によって水平方向に折り返さ れた光ビームLが第9ミラー719に到達するまでの直 線部は、第1、第2 f θ レンズ4 0.0、5 0 0の上方の 箇所を水平方向に通過する光路部分を有している。さら に、上記光路LDのうち、第9ミラー719によって折 り返された光ビームしが第3 f 0 レンズ600Dを通過 して感光ドラム20Dに到達するまでの直線部は、ポリ ゴンミラー部300と第1f θ レンズ600Dの間の箇 所を通過する光路部分を有している。

【0039】上述した第2の実施の形態においても第1 の実施の形態と同様の作用効果を奏することはもちろん である。

【0040】図4は本発明の第3の実施の形態のマルチ ビーム光源走査装置を縦断面から見た状態を示す断面図 である。図4において、第1、第2の実施の形態を示す 図1、図2、図3と同一部分には同一の符号を付してそ の説明を省略する。第3の実施の形態のマルチビーム光 源走査装置1000Aが第2の実施の形態のマルチビー ム光源走査装置1000と異なるのは、感光ドラム20 A乃至20Dと、第3f0レンズ600A乃至600D および光路屈曲部材群720との配置の上下関係が逆と なって点である。すなわち、筐体1の底壁10の上方に 底壁10と間隔をおいて上壁20が水平方向に延在さ れ、この上壁20の上方に上壁20の上面20Aと間隔 をおいて、4個の感光ドラム20A、20B、20C、 20Dが互いに間隔をおいて軸線が平行をなした状態で 回転可能に設けられている。また、上壁20には、各感 光ドラム20A乃至20Dの下部に臨む箇所に、各感光 ドラム20A乃至20Dの軸線と平行に、すなわち光ビ ームLの主走査方向にわたって延在する開口22A乃至 22Dがそれぞれ上壁20の厚さ方向(鉛直方向)に貫 通して設けられている。これら開口の下面20B側の周 縁部に図略の第3 f θ レンズ用保持部材が設けられ、こ れら保持部材によって第3 f 0 レンズ600A乃至60

【0041】光路屈曲部材群720は、第1乃至第9ミ ラー721乃至729から構成されている。第1ミラー 721は、光源部100から出射された光ビームしのう ち、鉛直方向で最も上方に位置する光ビームしをポリゴ ンミラー部300から最も遠い位置に配置されている感 光ドラム20Aに導く光路LAを構成している。第2、 第3ミラー722、723は、光源部100から出射さ れた光ビームLのうち、鉛直方向で上方から2番目に位 置する光ビームしをポリゴンミラー部300から2番目 に遠い位置に配置されている感光ドラム20Bに導く光 路LBを構成している。第4乃至第6ミラー724乃至 726は、光源部100から出射された光ビームLのう ち、鉛直方向で上方から3番目に位置する光ビームした ポリゴンミラー部300から3番目に遠い位置に配置さ れている感光ドラム20Cに導く光路LCを構成してい る。第7乃至第9ミラー727乃至729は、光源部1 00から出射された光ビームLのうち、鉛直方向で上方 から4番目(すなわち鉛直方向で最も下方)に位置する 光ビームしをポリゴンミラー部300から4番目に遠い 位置(すなわち最も近い位置)に配置されている感光ド ラム20Dに導く光路LDを構成している。これら第1 乃至第7ミラー721乃至727はそれぞれ光ビームし の主走査方向にわたって延在して設けられており、図略 の保持部材を介して上壁20の下面20Bに取着されて

【0042】なお、第1乃至第7ミラー721乃至72 7によって構成される各光路 LA乃至 LDは、第2の実 施の形態(図3)と上下方向の関係が逆になるだけであ るため、その詳細な説明は省略する。ただし、図4から 明らかなように、光路LDのうち、第8ミラー728に よって水平方向に折り返された光ビームしが第9ミラー 729に到達するまでの直線部は、第1、第2 f 0 レン ズ400、500の下方の箇所を通過する光路部分を有 している。さらに、上記光路LDのうち、第9ミラー7 29によって折り返された光ビームしが第3 f 0 レンズ 600Dを通過して感光ドラム20Dに到達するまでの 直線部は、ポリゴンミラー部300と第1 f θ レンズ6 00Dの間の箇所を通過する光路部分を有している。上 述した第3の実施の形態においても第1の実施の形態と 同様の作用効果を奏することはもちろんである。

【0043】図5は本発明の第4の実施の形態のマルチ ビーム光源走査装置を縦断面から見た状態を示す断面図 である。図5において、第1の実施の形態を示す図1、 図2と同一部分には同一の符号を付してその説明を省略 する。第4の実施の形態のマルチビーム光源走査装置1 0000が第1の実施の形態のマルチビーム光源走査装 置1000と異なるのは、光路屈曲部材群730の構成 のみであるため、以下では光源屈曲部材群730の構成 を中心に説明する。

16

1、第2ミラー732と第3ミラー733が一体的に構 成された第1ミラー部730A、第4ミラー734と第 5ミラー735が一体的に構成された第2ミラー部73 OB、第6ミラー736、第7ミラー737によって構 成されている。すなわち、第1の実施の形態と異なるの は第2、第3ミラー732、733を第1ミラー部73 0Aによって一体的に構成し、第4、第5ミラー73 4、735を第2ミラー部730Bによって一体的に構 成した点である。これら第1、第2ミラー部730A、 730Bを設けることによって複数のミラーを一体的に 構成しているので、ミラーの点数を削減することができ る利点がある。これら第1乃至第7ミラー731乃至7 37の位置関係と作用は、第1の実施の形態における第 1乃至第7ミラー701乃至707の位置関係と作用と 同じであるためその説明は省略する。ただし、図5から 明らかなように、光路LDのうち、第6ミラー736に よって上方に折り返された光ビームしが第7ミラー73 7に到達するまでの直線部は、第1、第2 [θ レンズ 4 00、500の上方の箇所を通過する光路部分を有して いる。さらに、上記光路LDのうち、第7ミラー737 によって折り返された光ビームしが第3 f θ レンズ 6 0 ODを通過して感光ドラム20Dに到達するまでの直線 部は、ポリゴンミラー部300と第1f0レンズ600 Dの間の箇所を通過する光路部分を有している。上述し た第4の実施の形態においても第1の実施の形態と同様 の作用効果を奏することはもちろんである。

【0045】図6は本発明の第5の実施の形態のマルチ ビーム光源走査装置を縦断面から見た状態を示す断面図 である。図6において、第1の実施の形態を示す図1、 図2と同一部分には同一の符号を付してその説明を省略 する。第5の実施の形態のマルチビーム光源走査装置1 000Eが第1の実施の形態のマルチビーム光源走査装 置1000と異なるのは、光路厄曲部材群740の構成 のみであるため、以下では光源屈曲部材群740の構成 を中心に説明する。

【0046】光源屈曲部材群740は、第1ミラー74 1と、第2ミラー742および第3ミラー743が形成 された第1プリズム740Aと、第4ミラー744およ び第5ミラー745が形成された第2プリズム740日 と、第6ミラー746と、第7ミラー747と、第8ミ ラー748とから構成されている。第5の実施の形態で は、第1、第2プリズム740A、740Bを設けるこ とによって複数のミラーを一体的に構成しているので、 ミラーの点数を削減することができる利点がある。

【0047】第1ミラー741は、光源部100から出 射された光ビームしのうち、鉛直方向で最も下方に位置 する光ビームしをポリゴンミラー部300から最も遠い 位置に配置されている感光ドラム20Aに導く光路LA を構成している。第2、第3ミラー742、743は、 【0044】光源屈曲部材群730は、第1ミラー73 50 光源部100から出射された光ビームしのうち、鉛直方

20

る。

向で下方から2番目に位置する光ビームしをポリゴンミ ラー部300から2番目に遠い位置に配置されている感 光ドラム20Bに導く光路LBを構成している。第4、 第5ミラー744、745は、光源部100から出射さ れた光ビームしのうち、鉛直方向で下方から3番目に位 置する光ビームしをポリゴンミラー部300から3番目 に遠い位置に配置されている感光ドラム20 Cに導く光 路しCを構成している。第6、第7、第8ミラー74 6、747、748は、光源部100から出射された光 ビームしのうち、鉛直方向で下方から4番目(すなわち 鉛直方向で最も上方) に位置する光ビームしをポリゴン ミラー部300から4番目に遠い位置(すなわち相対的 に最も近い位置) に配置されている感光ドラム20Dに 導く光路LDを構成している。

【0048】これら第1乃至第8ミラー741乃至74 7はそれぞれ光ビームLの主走査方向にわたって延在し て設けられており、第1、第6乃至第8ミラー741、 746、748と、第1、第2プリズム740A、74 0 Bは図略の保持部材を介して底壁10の上面10Aに 取着されている。

【0049】ここで、第1乃至第8ミラー741乃至7 48によって構成される光路屈曲部材群700によって 構成される光路について詳細に説明する。単一の第15 ラー741によって構成される光路LAは、第2f0レ ンズ500の出射面520から第1ミラー701に到達 するまでの光ビームLが直進する直線部と、第1ミラー 741によって光ビームLが下方に折り返される屈曲部 と、第1ミラー741によって折り返された光ビームし が第3fθレンズ600Aを通過して感光ドラム20A に到達するまでの直線部とを有して構成されている。つ 30 まり、上記光路LAは、光ビームLが直進する2つの直 線部と、光ビームの向きが変わる単一の屈曲部を有して 構成されている。

【0050】第2、第3ミラー742、743によって 構成される光路LBは、第2f θレンズ500の出射面 520から第2ミラー742に到達するまでの光ビーム しが直進する直線部と、第2ミラー742によって光ビ ームしが上方に折り返される屈曲部と、第2ミラー74 2によって折り返された光ビームしが第3ミラー743 に到達するまでの直線部と、第3ミラー743によって 光ビームしが下方に折り返される屈曲部と、第3ミラー 743によって折り返された光ビームしが第3 f 0 レン ズ600Bを通過して感光ドラム20Bに到達するまで の直線部とを有して構成されている。つまり、上記光路 LBは、光ビームLが直進する3つの直線部と、光ビー ムの向きが変わる2つの屈曲部を有して構成されてい

【0051】第4、第5ミラー744、745によって 構成される光路LCは、第2「0レンズ500の出射面

しが直進する直線部と、第4ミラー744によって光ビ ームLが上方に折り返される風曲部と、第4ミラー74 4によって折り返された光ビームしが第5ミラー745 に到達するまでの直線部と、第5ミラー745によって 光ビームしが下方に折り返される屈曲部と、第5ミラー 745によって折り返された光ビームLが第3fθレン ズ600℃を通過して感光ドラム20℃に到達するまで の直線部とを有して構成されている。つまり、上記光路 LCは、光ビームLが直進する3つの直線部と、光ビー

ムの向きが変わる2つの屈曲部を有して構成されてい

18

【0052】第6乃至第8ミラー746乃至748によ って構成される光路LDは、第2 f 0 レンズ500の出 射面520から第6ミラー746に到達するまでの光ビ ームしが直進する直線部と、第6ミラー746によって 光ビームしが上方に折り返される屈曲部と、第6ミラー 746によって折り返された光ビームLが第7ミラー7 47に到達するまでの直線部と、第7ミラー747によ って光ビームレが水平方向に折り返される屈曲部と、第 7ミラー747によって折り返された光ビームしが第8 ミラーに到達するまでの光ビームしが直進する直線部 と、第8ミラー748によって下方に折り返される屈曲 部と、第8ミラー748によって折り返された光ビーム Lが第3 [0 レンズ600Dを通過して感光ドラム20 Dに到達するまでの直線部とを有して構成されている。 つまり、上記光路LDは、光ビームLが直進する4つの 直線部と、光ビームの向きが変わる3つの屈曲部を有し て構成されている。また、上記光路LDのうち、第7ミ ラー747によって水平方向に折り返された光ビームし が第8ミラー748に到達する第3f0レンズ600D を通過して感光ドラム20Dに到達するまでの直線部 は、第1、第2「0レンズ400、500の上方の箇所 を水平方向に通過する光路部分を有している。また、上 記光路LDのうち、第8ミラー748によって折り返さ れた光ビームしが第3 f 0 レンズ600Dを通過して感 光ドラム20Dに到達するまでの直線部は、ポリゴンミ ラー部300と第1f θレンズ600Dの間の箇所を通 過する光路部分を有している。

【0053】上述した第5の実施の形態においても第1 の実施の形態と同様の作用効果を奏することはもちろん である。

【0054】図7は本発明の第6の実施の形態のマルチ ビーム光源走査装置を縦断面から見た状態を示す断面図 である。図7において、第1の実施の形態を示す図1、 図2と同一部分には同一の符号を付してその説明を省略 する。第6の実施の形態のマルチビーム光源走査装置1 000Fが第1の実施の形態のマルチビーム光源走査装 置1000と異なるのは、感光ドラム、第310レン ズ、光路屈曲部材群の配置であるため、以下ではこれら 5 2 0 から第 4 ミラー 7 4 4 に到達するまでの光ビーム 50 感光ドラム、第 3 f 0 レンズ、光路屈曲部材群の位置関

係について中心に説明する。

【0055】図7に示されているように、平面から見て ポリゴンミラー部300の一側に1つの第3 f θ レンズ 600Dが配設され、ポリゴンミラー部300の他側に 残り3つの第3「θレンズ600A乃至600Cが配設 されている。同様に、平面から見てポリゴンミラー部3 00の一側に1つの感光ドラム20Dが配設され、ポリ ゴンミラー部300の他側に残り3つの感光ドラム20 A乃至20Cが配設されている。なお、特許請求の範囲 におけるポリゴンミラーの一側とは、上記ポリゴンミラ 一部300の一側に相当するものであり、ポリゴンミラ -320によって偏向走査される光ビームLの光路が位 置する側(前側)である。また、特許請求の範囲におけ るポリゴンミラーの他側とは、上記ポリゴンミラー部3 00の他側に相当するものであり、上記一側と反対側、 すなわち、ポリゴンミラー320によって偏向走査され る光ビームしの光路が位置しない側(後側)である。

【0056】光路屈曲部材群750は、第1乃至第10 ミラー751乃至760を備えている。第1ミラー75 1は、光源部100から出射された光ビームしのうち、 鉛直方向で最も下方に位置する光ビームしをポリゴンミ ラー部300の他側でポリゴンミラー部320から最も 遠い位置に配置されている感光ドラム20Aに導く光路 LAを構成している。第2乃至第4ミラー752乃至7 54は、光源部100から出射された光ビームしのう ち、鉛直方向で下方から2番目に位置する光ビームしを ポリゴンミラー部300の他側でポリゴンミラー部30 0から2番目に遠い位置に配置されている感光ドラム2 OBに導く光路LBを構成している。第5乃至第7ミラ ー755乃至757は、光源部100から出射された光 30 ビーム Lのうち、鉛直方向で下方から3番目に位置する 光ビームしをポリゴンミラー部300の他側でポリゴン ミラー部300から最も近い位置に配置されている感光 ドラム20Cに導く光路してを構成している。第8乃至 第10ミラー758乃至760は、光源部100から出 射された光ビームしのうち、鉛直方向で下方から4番目 (すなわち鉛直方向で最も上方) に位置する光ビームし をポリゴンミラー部300の一側に配置されている感光 ドラム20Dに導く光路LDを構成している。

【0057】これら第1乃至第10ミラー751乃至7 60はそれぞれ光ビームしの主走査方向にわたって延在 して設けられており、図略の保持部材を介して底壁10 の上面10Aに取着されている。

【0058】第1乃至第10ミラー751乃至760に よって構成される光路屈曲部材群750によって構成さ れる光路について詳細に説明する。単一の第1ミラー7 51によって構成される光路LAは、第2 f 0 レンズ 5 00の出射面520から第1ミラー701に到達するま での光ビームしが直進する直線部と、第1ミラー751

1ミラー751によって折り返された光ビームしが第3 f θ レンズ 6 O O A を通過して感光ドラム 2 O A に到達 するまでの直線部とを有して構成されている。つまり、 上記光路LAは、光ビームLが直進する2つの直線部 と、光ビームの向きが変わる単一の屈曲部を有して構成 されている。

【0059】第2乃至第4ミラー752乃至754によ って構成される光路LBは、第2f0レンズ500の出 射面520から第2ミラー752に到達するまでの光ビ ームLが直進する直線部と、第2ミラー752によって 光ビームしが下方に折り返される屈曲部と、第2ミラー 752によって折り返された光ビームしが第3ミラー7 53に到達するまでの直線部と、第3ミラー753によ って光ビームしが上方に折り返される風曲部と、第3ミ ラー753によって折り返された光ビームLが第4ミラ -754に到達するまでの光ビームしが直進する直線部 と、第4ミラー754によって光ビームLが下方に折り 返される屈曲部と、第4ミラー754によって折り返さ れた光ビームしが第3 f θ レンズ600 B を通過して感 20 光ドラム20日に到達するまでの直線部とを有して構成 されている。つまり、上記光路しBは、光ビームしが直 進する4つの直線部と、光ビームの向きが変わる3つの 屈曲部を有して構成されている。

【0060】第5乃至第7ミラー755乃至757によ って構成される光路 L C は、第2 f θ レンズ 5 0 0 の出 射面520から第5ミラー755に到達するまでの光ビ ームしが直進する直線部と、第5ミラー755によって 光ビームLが上方に折り返される屈曲部と、第5ミラー 755によって折り返された光ビームしが第6ミラー7 56に到達するまでの直線部と、第6ミラー756によ って光ビームLが水平方向に折り返される屈曲部と、第 6ミラー756によって折り返された光ビームしが第7 ミラー757に到達するまでの直線部と、第7ミラー7 57によって光ビームLが下方に折り返される屈曲部 と、第7ミラー757によって折り返された光ビームし が第3 f 0 レンズ600 C を通過して感光ドラム20 C に到達するまでの直線部とを有して構成されている。つ まり、上記光路LCは、光ビームLが直進する4つの直 線部と、光ビームの向きが変わる3つの屈曲部を有して 40 構成されている。

【0061】第8乃至第10ミラー758乃至760に よって構成される光路LDは、第2f θレンズ500の 出射面520から第8ミラー758に到達するまでの光 ビームLが直進する直線部と、第8ミラー758によっ て光ビームしが上方に折り返される屈曲部と、第8ミラ ー758によって折り返された光ビームしが第9ミラー 759に到達するまでの直線部と、第9ミラー759に よって光ビームしが水平方向に折り返される屈曲部と、 第9ミラー759によって折り返された光ビームしが第 によって光ビームしが下方に折り返される屈曲部と、第 50 10ミラー760に到達するまでの直線部と、第10ミ

【0062】すなわち、ポリゴンミラー320の他側を 通過する光路部分を有する残りの全ての光路LA乃至L Cは、ポリゴンミラー320の他側でポリゴンミラー3 20から順次離れた箇所に位置するように配置された3 つの感光ドラム20A乃至20Cに導かれるように構成 され、前記残り全ての光路LA乃至LCのうち、ポリゴ ンミラー320から最も近い位置に配設される感光ドラ ム20Cに光ビームしを導く光路LCは、ポリゴンミラ -320と第1fθレンズ400との間の箇所を通過す る光路部分を有して構成されている。したがって、第6 の実施の形態では、ポリゴンミラー部300の一側に1 つの第3 f θ レンズ 6 0 0 D と感光ドラム 2 0 D を配置 すると共に、他側に残り3つの第3 f θ レンズ600Α 乃至600Cと感光ドラム20A乃至20Cを配置する 構成が可能となる利点がある。そして、このように配置 することによって、ポリゴンミラー320から各感光ド ラム20A乃至20Dまでの相対距離を短く構成するこ とが可能となり、装置全体を小型化することができると いう効果を奏する。

光路部分を有している。

【0063】また、上記光路LDのうち、第9ミラー759によって折り返された光ビームLが第10ミラー760に到達するまでの直線部は、第1、第2f0レンズ400、500の上方の箇所とポリゴンミラー部300の上方の箇所とを水平方向に沿って通過する光路部分を有している。

【0064】上述した第6の実施の形態においても、ポリゴンミラー320から最も近い位置に配設される感光ドラム20Dに光ビームLを導く光路LDは、ポリゴンミラー320と第1fのレンズ400との間の箇所を通過する光路部分を有しているため、平面から見てポリゴンミラー320と感光ドラム20Dの間、およびポリゴンミラー320と第3fのレンズ600Dの間の相対距離をそれぞれ短くすることが可能となり、ポリゴンミラー320から感光ドラム20Dまでの相対距離を短くす 50

22 ることが可能となる。したがって、第1の実施の形態と 同様の作用効果を奏することはもちろんである。

【0065】なお、上述した第1乃至第6の実施の形態では、光源部100に4つの半導体レーザ120A乃至120Dを設け、4色(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)に対応した4つの光ビームしを出射させ、第1、第3f0レンズ400、500によって4つの光ビームしをそれぞれ副走査方向に収束させる構成としたが、本発明は光源と光ビームしの個数が4つである構成に限定されるものではない。例えば、3つの光源のそれぞれによってイエロー、マゼンタ、シアンの3色に対応した3つの光ビームしを出射させ、第1、第3f0レンズ400、500によって3つの光ビームしをそれぞれ副走査方向に収束させる構成とすることもできることはもちろんである。

[0066]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように本発明は、 複数の光源と、ポリゴンミラーと、ポリゴンミラーによ って偏向走査された各光ビームをそれぞれ複数の被照射 対象物に収束させて導く光学系とを備えるマルチビーム 光源走査装置において、光学系は光路を折り返させる複 数の光路屈曲部材からなる光路屈曲部材群を有し、光路 屈曲部材群により、ポリゴンミラーから各被照射対象物 に至る複数の光路の光路長が全て同一となるように構成 され、光路屈曲部材群によって構成される各光路のう ち、ポリゴンミラーから最も遠い位置に配設される被照 射対象物に光ビームを導く光路は、光ビームが直進する 2つの直線部と、光ビームの向きが変わる単一の屈曲部 を有して構成されていることを特徴とする。そのため、 ポリゴンミラーから最も遠い位置に配置されている被照 射対象物までの光路の光路長を必要最小限の長さに抑え れば、ポリゴンミラーから他の被照射対象物までの光路 長も上記光路長と同じ必要最小限の長さとなるように構 成することができる。したがって、ポリゴンミラーと各 被照射対象物間の相対距離を短く構成することができる とともに、各被照射対象物間の間隔を十分に確保するこ とができる。これにより装置全体を小型化するととも に、各被照射対象物の周囲に配設される各プロセス部材 のスペースを十分に確保することができる。

【0067】また、本発明は、光ビームを出射する複数の光源と、各光源から出射された各光ビームを偏向走査するポリゴンミラーと、ポリゴンミラーによって偏向走査された各光ビームをそれぞれ複数の被照射対象物に収束させて導く光学系とを備えるマルチビーム光源走査装置において、光学系は光ビームを収束させる複数の「0レンズからなる「0レンズ群と、光路を折り返させる複数の光路風曲部材からなる光路風曲部材群を有し、光路風曲部材群により、ポリゴンミラーから各被照射対象物に至る複数の光路の光路長が全て同一となるように構成され、複数の被照射対象物は、ポリゴンミラーの一側で

ポリゴンミラーから順次離れた箇所に位置するように配置され、光路屈曲部材群によって構成される各光路のうち、ポリゴンミラーから最も近い位置に配設される被照射対象物に光ビームを導く光路は、ポリゴンミラーと第1f0レンズとの間の箇所を通過する光路部分を有して構成されていることを特徴とする。そのため、ポリゴンミラーとこのポリゴンミラーから最も近い位置に配設される被照射対象物との間の相対距離を短く構成するととが可能となる。したがって、装置全体を小型化するとともに、各被照射対象物の周囲に配設される各プロセス部材のスペースを十分に確保することができる。

【0068】また、本発明は、光ビームを出射する3つ 以上の光源と、各光源から出射された各光ビームを偏向 走査するポリゴンミラーと、ポリゴンミラーによって偏 向走査された各光ビームを光ビームの数に等しい数の被 照射対象物に収束させて導く光学系とを備えるマルチビ ーム光源走査装置において、光学系は光路を折り返させ る複数の光路屈曲部材からなる光路屈曲部材群を有し、 光路屈曲部材群により、ポリゴンミラーから各被照射対 20 象物に至る複数の光路の光路長が全て同一となるように 構成され、ポリゴンミラーから各被照射対象物に至る複 数の光路のうちの1つの光路はポリゴンミラーの一側を 通過する光路部分を有し、残りの全ての光路はポリゴン ミラーの他側を通過する光路部分を有するように構成さ れていることを特徴とする。そのため、ポリゴンミラー の一側に1つの被照射対象物を、他側に他の被照射対象 物をそれぞれ配置することができ、ポリゴンミラーから 各被照射対象物までの相対距離を短く構成するととも

に、各被照射対象物間の間隔を十分に確保することが可能となる。したがって、装置全体を小型化するととともに、各被照射対象物の周囲に配設される各プロセス部材のスペースを十分に確保することができる。

24

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態のマルチビーム光源 走査装置の構成を示す平面図である。

【図2】図1をAA線断面から見た状態を示す断面図である。

10 【図3】本発明の第2の実施の形態のマルチビーム光源 走査装置を縦断面から見た状態を示す断面図である。

【図4】本発明の第3の実施の形態のマルチビーム光源 走査装置を縦断面から見た状態を示す断面図である。

【図5】本発明の第4の実施の形態のマルチビーム光源 走査装置を縦断面から見た状態を示す断面図である。

【図6】本発明の第5の実施の形態のマルチビーム光源 走査装置を縦断面から見た状態を示す断面図である。

【図7】本発明の第6の実施の形態のマルチビーム光源 走査装置を縦断面から見た状態を示す断面図である。

20 【符号の説明】

1000、1000A~1000E マルチビーム光源 走査装置

20A乃至20D 感光ドラム

100 光源部

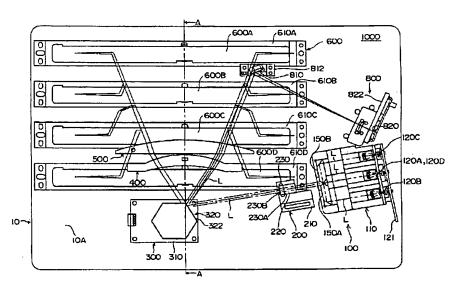
320 ポリゴンミラー

700、710、720、730、750 光路屈曲部 材群

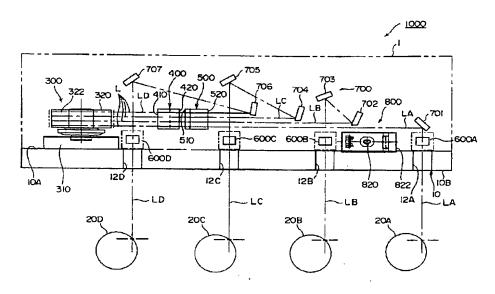
L 光ビーム

LA~LD 光路

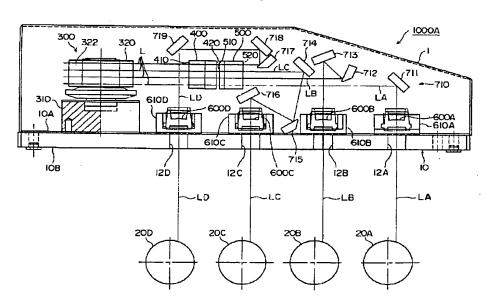
【図1】

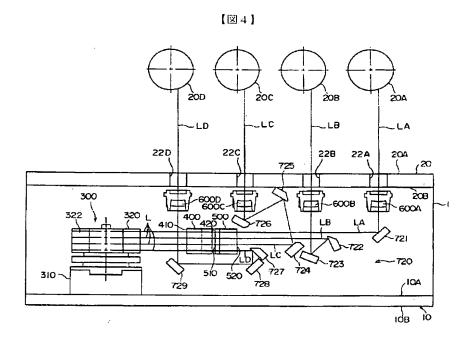


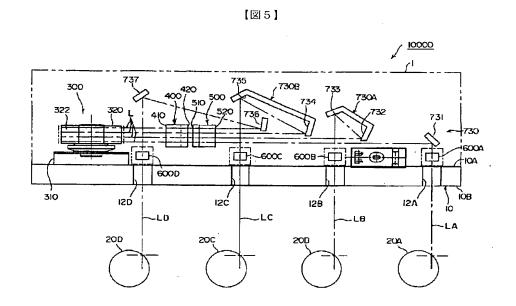
【図2】



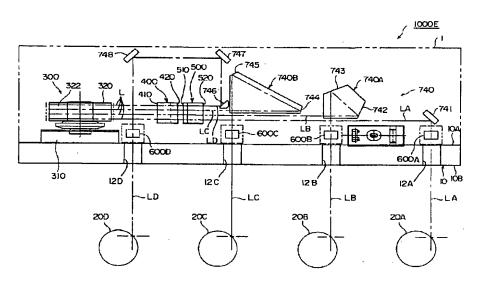
【図3】



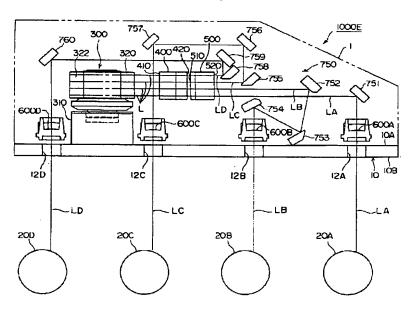




【図6】



【図7】



フロントページの続き

(72) 発明者 小田野 民則

東京都板橋区前野町2丁目**36**番9号 旭光 学工業株式会社内 (72) 発明者 三ヶ尻 晋

東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光 学工業株式会社内

Fターム(参考) 2C362 BA50 BA51 BA54 BA83 BA87

BA90 CA39 DA03 DA04 DA06 2H045 AA01 BA22 BA24 CA63 CA82

CA98 DA02 DA04